

ARECプラザ 第112回リレー講演会

計測・センサ分野

日時：2010年5月20日(木) 15:00～18:00

終了後、交流会 [参加費：無料]

場所：AREC (上田市産学官連携支援施設) 4階

(上田市常田 3-15-1 信州大学繊維学部内 Tel: 0268-21-4377)

講演1

15:00～16:00

演題 『パラメトリック磁気センサの開発』

講師 国立長野高専 電気電子工学科 准教授 柄澤 孝一 氏

講演概要 パラメトリック磁気センサは磁束応答形に属し、信号周波数に無関係に一定で信号磁界に比例した出力電圧を得ることができる。他の磁気センサに比べて高感度であり、増幅回路なしで1V以上の出力電圧が得られている。これまで、磁気センサ内の回路を検討し、乾電池駆動可能で携帯できるパルス励振形パラメトリック磁気センサを開発している(現在、特許申請中)。今回は、パラメトリック磁気センサの動作原理、応用例について紹介する。

講演2

16:00～16:50

演題 『記録計(レコーダ)の応用計測』

講師 日置電機株式会社 PMI部 技術1課 課長 関 智志路 氏

講演概要 レコーダは、電気信号に変換された工業量・物理量などを測定し、記録紙上にデータを残したり、記録メディアにデータを保存するための測定器である。測定対象は、電圧、電流、歪み、振動などの高速信号から圧力、温度のような低速変動までさまざまであり、記録データより機器トラブル、異常現象の解決あるいは物質の特性・性能などを読みとることができる。本講では、レコーダの基本概要からはじめ当社 8860-50 メモリハイコーダを用いた様々な応用計測を紹介する。

休憩 10分

講演3

17:00～17:50

演題 『圧力センサ技術』

講師 長野計器株式会社 丸子電子機器工場 成膜部 技術課 吉田 直樹 氏

講演概要 温度・流量と並んで圧力は産業・プロセス分野において重要な管理対象のプロセス変量である。様々な圧力・圧力媒体の圧力計測にセンサ技術がどう適合して開発されてきたか、圧力計測・制御に用いられる当社の圧力センシング技術について、最近の技術開発トピックスを含めてご紹介いたします。

お申込先

ARECプラザ宛 メール (mousikomi@arecplaza.jp) またはファクス (0268-21-4382) でお申し込みください。

ARECプラザ 第112回リレー講演会 参加申込書		[平成22年5月20日(木)]	
企業・機関名			
参加者名			
所属・役職	電話番号		
メールアドレス	ファクス番号		

ご記入いただいた個人情報(御社名、所属・役職、氏名)は参加者名簿として、講演会参加者の方々に配布する予定です。